



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104841523 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 19

(21) 申请号 201510237717. 2

(22) 申请日 2015. 05. 12

(71) 申请人 朱德金

地址 235100 安徽省淮北市濉溪县经济开发区
区玉兰花城超市

(72) 发明人 朱德金

(51) Int. Cl.

B02C 15/00(2006. 01)

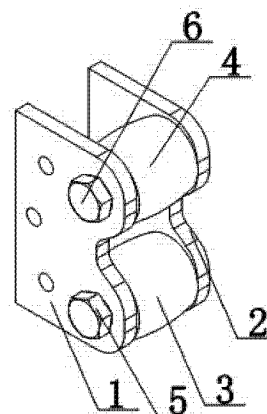
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种研磨辊限位架

(57) 摘要

本发明公开了一种研磨辊限位架,包括第一侧板与第二侧板,第一侧板与第二侧板呈平行布置,第一侧板与第二侧板之间设有第一导向辊与第二导向辊,第一导向辊与第二导向辊呈平行布置;第一导向辊与第二导向辊之间设有间隙。本发明可以将该限位架紧靠研磨辊,研磨辊与第一导向辊、第二导向辊紧靠,研磨辊的旋转可以带动第一导向辊、第二导向辊旋转,从而方便研磨辊对物料进行研磨处理。



1. 一种研磨辊限位架,包括第一侧板与第二侧板,其特征在于:第一侧板与第二侧板呈平行布置,第一侧板与第二侧板之间设有第一导向辊与第二导向辊,第一导向辊与第二导向辊呈平行布置;第一导向辊与第二导向辊之间设有间隙。

2. 根据权利要求 1 所述的研磨辊限位架,其特征在于:第一导向辊通过第一插销分别与第一侧板、第二侧板连接。

3. 根据权利要求 1 所述的研磨辊限位架,其特征在于:第二导向辊通过第二插销分别与第一侧板、第二侧板连接。

一种研磨辊限位架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种限位架,特别涉及一种研磨辊限位架。

背景技术

[0002] 辊磨机主要有盘磨、环磨、辊磨、雷蒙磨、摆式辊磨等,工作原理:物料在两个滚压的滚压面之间或在滚压着的研磨体和一个轨道之间受到压力而粉碎;现有的研磨辊研磨物料效率低。

发明内容

[0003] 本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种可以将该限位架紧靠研磨辊,研磨辊与第一导向辊、第二导向辊紧靠,研磨辊的旋转可以带动第一导向辊、第二导向辊旋转,从而方便研磨辊对物料进行研磨处理的研磨辊限位架。

[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种研磨辊限位架,包括第一侧板与第二侧板,第一侧板与第二侧板呈平行布置,第一侧板与第二侧板之间设有第一导向辊与第二导向辊,第一导向辊与第二导向辊呈平行布置;第一导向辊与第二导向辊之间设有间隙。

[0005] 进一步地,所述第一导向辊通过第一插销分别与第一侧板、第二侧板连接。

[0006] 进一步地,所述第二导向辊通过第二插销分别与第一侧板、第二侧板连接。

[0007] 采用上述技术方案的研磨辊限位架,可以将该限位架紧靠研磨辊,研磨辊与第一导向辊、第二导向辊紧靠,研磨辊的旋转可以带动第一导向辊、第二导向辊旋转,从而方便研磨辊对物料进行研磨处理。

[0008]

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图 1 为本发明研磨辊限位架的结构示意图;

图 2 为本发明研磨辊限位架的部件分解图。

[0011]

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 如图 1 与图 2 所示,一种研磨辊限位架,包括第一侧板 1 与第二侧板 2,第一侧板 1

与第二侧板 2 呈平行布置,第一侧板 1 与第二侧板 2 之间设有第一导向辊 3 与第二导向辊 4,第一导向辊 3 与第二导向辊 4 呈平行布置;第一导向辊 3 与第二导向辊 4 之间设有间隙;第一导向辊 3 通过第一插销 5 分别与第一侧板 1、第二侧板 2 连接,第二导向辊 4 通过第二插销 6 分别与第一侧板 1、第二侧板 2 连接。

[0014] 本发明研磨辊限位架,可以将该限位架紧靠研磨辊,研磨辊与第一导向辊 3、第二导向辊 4 紧靠,研磨辊的旋转可以带动第一导向辊 3、第二导向辊 4 旋转,从而方便研磨辊对物料进行研磨处理。

[0015] 其中,第一导向辊 3 通过第一插销 5 分别与第一侧板 1、第二侧板 2 连接,第二导向辊 4 通过第二插销 6 分别与第一侧板 1、第二侧板 2 连接,所以安装方便。

[0016] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

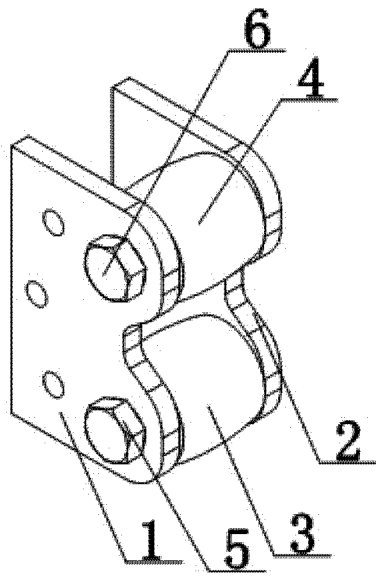


图 1

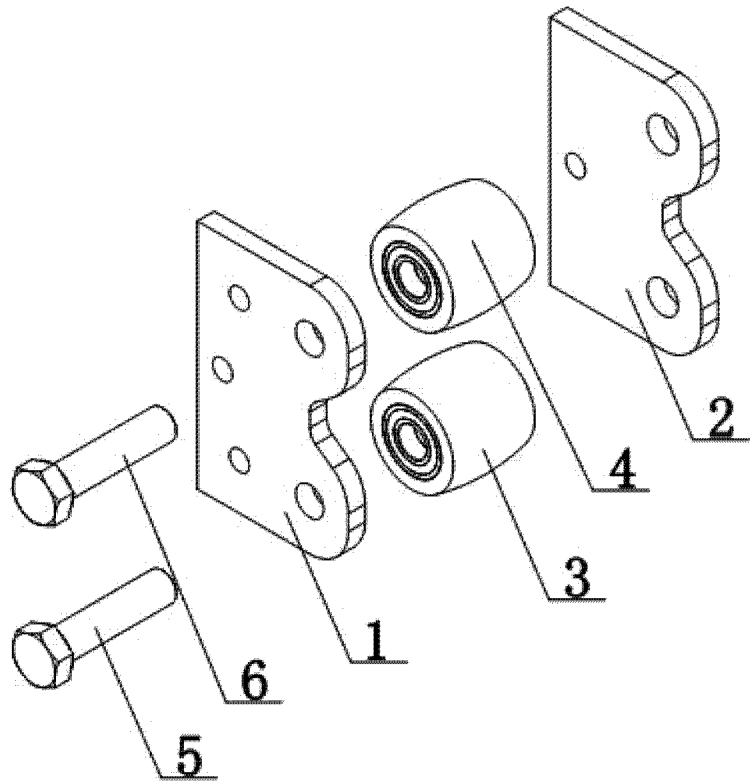


图 2